

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年4月22日(2010.4.22)

【公表番号】特表2007-535121(P2007-535121A)

【公表日】平成19年11月29日(2007.11.29)

【年通号数】公開・登録公報2007-046

【出願番号】特願2006-518977(P2006-518977)

【国際特許分類】

H 01 L 21/027 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/30 5 0 2 D

【手続補正書】

【提出日】平成22年3月8日(2010.3.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

対向する表面を有し、その間に延びて周縁表面となる側面を備えたテンプレートの寸法を変更するためのシステムにおいて、

互いに向き合って、ある距離だけ間隔を置いて配置されてペアとなっている接触部材をそれぞれが有する第1及び第2の本体と、

チャンバ内に位置付けられ、可変の容積を有し、前記容積の変化に応答して前記アクチュエータームが移動し、前記距離を変化させるよう前記第1の本体に結合されているプラダーと、

を備え、

前記第1の本体はアクチュエータームとそのアクチュエータームに隣接して配置されたチャンバとを具備し、前記接触部材のペアの1つは前記アクチュエータームの移動に応答して移動するよう前記アクチュエータームに結合されていることを特徴とするシステム。

【請求項2】

前記接触部材のペアの1つが柔軟な材料で形成されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。

【請求項3】

前記第1の本体は、前記接触部材のペアの1つから追加距離だけ離間して配置された追加の接触部材と追加のアクチュエータームとをさらに具備し、前記追加の接触部材は前記追加のアクチュエータームに結合され、前記プラダーが前記チャンバ内に配置され、前記アクチュエータームと前記追加のアクチュエータームの両方が前記容積の変化に応答して移動し、前記距離と前記追加距離の両方を変化させるようにすることを特徴とする請求項1に記載のシステム。

【請求項4】

関連する追加の容積を有する追加のプラダーをさらに具備し、前記本体は、前記接触部材のペアの1つから追加距離だけ離間して配置された追加の接触部材と追加のアクチュエータームとを備え、前記追加の接触部材は前記追加のアクチュエータームに結合され、前記追加のプラダーは前記チャンバ内に配置されて、前記追加のアクチュエータームは前記容積の変化に応答して移動し、前記距離の変化とは無関係に前記追加距離を変化

させるようにすることを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 5】

前記アクチュエータアームは、前記ブラダーが接触するアクチュエータ表面を含み、前記接触部材は前記周縁表面と接触するように適合された接触面を含み、前記接触面に関連する範囲は前記アクチュエータ表面に関連する範囲よりも小さいことを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 6】

前記アクチュエータアームは、前記テンプレートから離間して配置された平面内に位置する軸の周りで往復動をするよう前記第 1 の本体に取り付けられていることを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 7】

ある範囲を取り囲み、該範囲に面した円周表面を有する圧縮リングを更に有し、前記第 1 及び第 2 の本体は互いに向き合って前記円周表面に結合されることを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 8】

前記ブラダーは、前記チャンバ内に配置されて前記容積の増大に応答して前記距離を増大させることを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 9】

前記ブラダーは、前記チャンバ内に配置されて前記容積の増大に応答して前記距離を減少させることを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 10】

関連する追加の容積を有する追加のブラダーをさらに有し、前記ブラダー及び前記追加のブラダーはブラダーシステムとなり、前記ブラダーは、前記チャンバ内に配置されて前記容積の増大に応答して前記距離を増大させ、前記追加のブラダーは、前記チャンバ内に配置されて前記追加の容積の増大に応答して前記距離を減少させることを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 11】

対向する表面を有し、その間に延びて周縁表面となる側面を備えたテンプレートの寸法を変更するためのシステムにおいて、

各々が接触部材を含む本体の第 1 及び第 2 のペアを備え、前記接触部材は前記第 1 のペアの本体と関連付けられた第 1 のペアの接触部材と前記第 2 のペアの本体と関連付けられた第 2 のペアの接触部材とを有し、前記第 1 のペアの接触部材は互いに向き合って配置され、前記第 2 のペアの接触部材は互いに向き合って配置され、前記第 1 及び第 2 のペアの本体の各々の 1 つの本体はアクチュエータアームと該アクチュエータアームに隣接して配置されたチャンバとを含み、前記ペアの接触部材の 1 つが前記アクチュエータアームの移動に応答して移動するよう前記アクチュエータアームに結合され、

前記システムは、前記チャンバ内に位置付けられて可変の容積を有し、前記アクチュエータアームが前記容積の変化に応答して移動し、前記距離を変化させるよう前記第 1 の本体に結合されているブラダーを備えることを特徴とするシステム。

【請求項 12】

前記 1 つの本体は、前記接触部材のペアの 1 つから追加距離だけ離間して配置された追加の接触部材と追加のアクチュエータアームとを含み、前記追加の接触部材は前記追加のアクチュエータアームに結合され、前記ブラダーは前記チャンバ内に配置され、前記アクチュエータアーム及び前記追加のアクチュエータアームの両方が前記容積の変化に応答して移動し、前記距離及び前記追加距離の両方を変化させるようにすることを特徴とする請求項 11 に記載のシステム。

【請求項 13】

前記追加のアクチュエータアームと接触するための、関連する追加の容積を有する追加のブラダーをさらに有し、前記追加のブラダーは前記チャンバ内に配置され、前記追加のアクチュエータアームは前記追加の容積の変化に応答して移動し、前記距離の変化とは無

関係に前記追加距離を変化させるようにすることを特徴とする請求項 1 2 に記載のシステム。

【請求項 1 4】

前記第 1 及び第 2 のペアの各々の前記接触部材の 1 つは、柔軟な材料で形成されることを特徴とする請求項 1 3 に記載のシステム。

【請求項 1 5】

前記アクチュエータアームは、前記ブラダーが接触するアクチュエータ表面を含み、前記接触部材は前記周縁表面と接触するように適合された接触面を含み、前記接触面に関連する範囲は前記アクチュエータ表面に関連する範囲よりも小さいことを特徴とする請求項 1 1 に記載のシステム。

【請求項 1 6】

前記アクチュエータアームは、前記テンプレートから離間して配置された平面内に位置する軸の周りで往復動をするよう前記第 1 の本体に取り付けられていることを特徴とする請求項 1 1 に記載のシステム。

【請求項 1 7】

ある範囲を取り囲み、該範囲に面した円周表面を有する圧縮リングをさらに有し、前記第 1 及び第 2 のペアの本体は前記円周表面に結合され、前記第 1 のペアに関連付けられた前記本体は互いに向き合って配置され、前記第 2 のペアに関連付けられた前記本体は互いに向き合って配置されることを特徴とする請求項 1 1 に記載のシステム。

【請求項 1 8】

対向する表面を有し、その間に延びて周縁表面となる側面を備えたテンプレートの寸法を変更するためのシステムにおいて、

前記システムは、

離間して配置された接触部材のペアを含み、該離間して配置された接触部材のペアの間で前記周縁表面を圧縮する圧縮装置を備え、

前記離間して配置された接触部材のペアの 1 つは前記周縁表面の形状と適合する材料で形成されており

前記圧縮装置は、互いに向き合ってある距離だけ間隔を置いて配置されてペアとされた接触部材をそれぞれが有する第 1 及び第 2 の本体と、前記チャンバ内に位置付けられて可変の容積を有し、前記容積の変化に応答して前記アクチュエータアームが移動し、前記距離を変化させるよう前記第 1 の本体に結合されているブラダーと、を更に備え、

前記第 1 の本体はアクチュエータアームと該アクチュエータアームに隣接して配置されたチャンバとを有し、前記接触部材のペアの 1 つが前記アクチュエータアームの移動に応答して移動するよう前記アクチュエータアームに結合されることを特徴とするシステム。

【請求項 1 9】

前記圧縮装置は、前記周縁表面を前記接触部材間で圧縮させる力を生成する発生器と、前記接触部材のペアの 1 つに対する単位面積当たりの力の量を増大させる力増幅器とをさらに有することを特徴とする請求項 1 8 に記載のシステム。

【請求項 2 0】

前記アクチュエータアームは、前記ブラダーが接触するアクチュエータ表面を有し、前記接触部材は前記周縁表面と接触するように適合された接触面を含み、前記接触面に関連する範囲は前記アクチュエータ表面に関連する範囲よりも小さいことを特徴とする請求項 1 8 に記載のシステム。

【請求項 2 1】

前記アクチュエータアームは、前記テンプレートから離間して配置された平面内に位置する軸の周りで往復動をするよう前記第 1 の本体に取り付けられていることを特徴とする請求項 1 8 に記載のシステム。

【請求項 2 2】

ある範囲を取り囲み、該範囲に面した円周表面を有する圧縮リングを更に含み、前記第

1 及び第 2 の本体が互いに向き合って前記円周表面に結合されることを特徴とする請求項
1 8 に記載のシステム。